催化学报

Chinese Journal of Catalysis

Vol. 31 No. 6

文章编号:0253-9837(2010)06-0711-05

DOI: 10.3724/SP.J.1088.2010.91213

研究论文:711~715

高透量PdAu/陶瓷复合膜的表征与性能评测

史 蕾^{1,2},曾高峰^{1,2},徐恒泳¹ ¹中国科学院大连化学物理研究所,辽宁大连116023 ²中国科学院研究生院,北京100049

摘要:采用化学镀方法在非对称氧化铝管状载体上制备出高性能PdAu合金膜.采用阶段性热处理方法通过X射线衍射技术监测PdAu 膜层合金化进程,发现在823K下H₂气氛中厚度为2μm,Au含量为17.37%的PdAu双金属膜层需要200h达到完全合金化;N₂/H₂气氛对PdAu合金化速率无显著影响,但N₂气氛中合金化后的PdAu合金膜表面粒子烧结更为严重.在623~823K下,与未进行化学镀Au时的纯Pd膜相比,PdAu合金膜的H₂渗透速率平均增加1.68倍,透氢活化能(*E*_a)降低38.51%;当温度低于573K时,PdAu合金膜的*E*_a由高温时的8.83kJ/mol增加到15.75kJ/mol,此时PdAu合金膜的H₂渗透控速步骤由体相扩散为主的H₂传质步骤过渡到由表面扩散为主的传质步骤.通过扫描电镜和能谱联用仪对PdAu合金膜的膜厚度和截面组成进行了表征.**关键词:**化学镀;无氰化学镀金;钯金复合膜;钯金合金;氢渗透

中图分类号: O643 文献标识码: A

Characterization and Performance of High-Flux PdAu/Ceramic Composite Membranes

SHI Lei^{1, 2}, ZENG Gaofeng^{1, 2}, XU Hengyong^{1,*}

¹Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Dalian 116023, Liaoning, China ²Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Abstract: A PdAu membrane was prepared by sequential electroless plating of Pd and Au onto the outside surface of porous γ -Al₂O₃ substrate followed by annealing and H₂/N₂ performance evaluation. X-ray diffraction was employed to study the PdAu alloy phase formation at 823 K under H₂ and N₂ atmospheres. Annealing experiments demonstrated that 200 h was needed to form a stoichiometrically homogeneous, 2-µm thick Pd_{82.63}Au_{17.37} membrane from sequentially deposited layers at 823 K and a noticeable particle agglomeration was observed under N₂ atmosphere. The performance of the PdAu alloy membrane was evaluated with respect to the H₂ flux and permselectivity between 823 and 423 K, which showed that the PdAu alloy membrane had higher H₂ flux and lower activation energy than those of pure Pd membrane. The activation energy in the high temperature range is consistent with bulk diffusion-limited H₂ transport, while the changes of these characteristics at lower temperatures below 573 K indicate desorption or surface limited H₂ flux. After the conclusion of gas studies, the PdAu membrane was broken, the thickness and composition of the PdAu layers were determined by SEM and EDX completely.

Key words: electroless plating; cyanide-free electroless gold plating; palladium-gold composite membrane; palladium-gold alloy; hydrogen permeation

氢是备受关注的二次能源,具有清洁、高效、应 用形式多等优点.致密 Pd 及 Pd 合金膜对 H₂具有选 择渗透性能,同时对许多涉氢反应具有催化性能;在 燃料电池、加氢脱氢膜反应等过程中,Pd 及 Pd 合金 膜具有潜在而广阔的应用前景^[1-5]. PdAu 催化剂在 氢氧直接合成 H₂O₂反应中的成功应用激发了人们 对 PdAu 催化膜反应器的研究^[2,6,7];同时,PdAu 合金 膜与纯 Pd 膜相比因具有更高的氢渗透量^[4,8]、高抗硫 性能^[9]、显著降低金属氢化相的相变温度^[10]以及更 优良的热循环性能^[11]等优点而备受关注.在分层镀

收稿日期: 2009-12-09.

联系人: 徐恒泳. Tel/Fax: (0411)84581234; E-mail: xuhy@dicp.ac.cn 基金来源: 国家重点基础研究发展计划 (973 计划, 2005CB221401).

工艺中.化学镀Pd技术经过多年研究已趋于成熟,但 采用化学镀Au技术用于制备PdAu合金膜的报道较 少,且人们通常采用的化学镀Au镀液中含有剧毒氰 化物,它的使用存在安全、环境等方面的隐患^[12].

Okazaki 等^[13]采用化学镀法(含氰化物)成功制 备了厚度为 5 μm 的 Pd₉₀Au₁₀ 合金膜. 该合金膜在 973 K下H2气氛中需24h完全合金化,透氢活化能 (E_a)在573~873 K范围内为11.3 kJ/mol(略低于纯 Pd 膜的 13.2 kJ/mol). Gade 等^[14]采用化学镀 Au 与电镀 Au 法相结合制备出厚度为 5.4~13 µm 的非担载 Pd_{1-x}Au_x (x = 0~0.13) 合金膜, 且比较了在1023 K下 退火处理前后 PdAu 合金膜 H₂渗透性能. 他们认为 前者的低氢渗透速率是由于Au在膜外表面的富集. 然而较高的退火温度对 Pd 合金膜有许多负面影响: (1)极易引起膜组件变形而影响密封效果; (2)金属 膜与载体之间的应力差异较大易导致合金膜在升降 温过程中破损[15]; (3)引起膜表面金属粒子烧结长大 从而导致合金膜形成缺陷降低膜的选择性能.因此, 在常用退火温度823K下考察合金进程更具有实际 意义.此外,采用单一无氰化学镀Au技术制备PdAu 合金膜鲜有报道,退火处理后PdAu合金膜的高低温 氡渗透性能更令人关注.

本文采用无氰化学镀Au 技术与传统化学镀Pd 技术相结合成功制备出厚度为2µm的高性能 PdAu 合金膜;通过X射线衍射(XRD)表征手段监测了Au 富集一侧 PdAu 合金衍射峰角度移动及峰形的变化 情况;同时比较了不同H₂/N₂气氛对合金化进程的 影响. PdAu薄膜在 823 K下H2气氛中进行充分退火 处理后,对423~823 K范围内H₂/N₂渗透性能进行了 评价;并对评价后的PdAu合金膜的形貌进行了扫描 电镜(SEM)和能谱(EDX)表征.

1 实验部分

1.1 载体预处理

膜的载体为南京工业大学生产的单通道非对称 多孔陶瓷管.载体的截面特征和清洗方法详见文献 [16]. 陶瓷管长 360 mm, 一端密闭, 密封端以上留 50 mm有效膜长,剩余表面涂瓷釉烧制密封.进行合金 化实验时,将陶瓷管截成 60 mm 的短样并且采用与 评价膜管完全相同的方法清洗、制备和烘干.为减小 载体差异对实验的影响,考察合金化实验和膜管评 价实验的载体均截自同一根陶瓷管.

1.2 化学镀

化学镀 Pd 方法详见文献[16]. 陶瓷管表面充分 敏化活化后首先在313K进行化学镀Pd60min.化学 沉积后的膜管在363K的去离子水中彻底清洗,393 K下烘干过夜,采用 XRD 方法进行合金化实验考察 的膜管直接进行下一步化学镀Au;进行评测的膜管 当完成高温Pd膜评测后再进行化学镀Au.

进行化学镀Au时,在已制备的Pd膜上继续进 行化学镀 Au 40 min, 方法详见文献[2]. 化学镀 Au 完 成后的膜管采用与化学镀 Pd 完成后相同的方法清 洗和烘干.

1.3 渗透评测和表征

膜管的气体渗透性能在程序控温不锈钢管式反 应器中评测^[17]. Pd 及 PdAu/陶瓷复合膜管与管式反 应器由石墨套圈密封. 在 N2 中以 1 K/min 的速率升 至623K,切换成H2以同样速率继续升温至823K,恒 定后进行 Pd 膜及 PdAu 膜的气体评测. 所用 H_2 和 N_2 均为高纯级(99.999%),用质量流量计控制进气流量, 用背压阀使管式反应器内压力高于大气压,用皂膜 流量计对气体渗透量进行计量. 需进行合金化考察 的短样,制备好后在 N2 中以 20 K/min 的速率升至 623 K, 切换成H2以同样速率继续升温至823 K, 恒定 不同时间后自然降温到 623 K,最后切换为 N,吹扫 自然降至室温.

金属膜的表面形貌、截面形貌、膜厚以及组成 在 QUANTA 200F 型 SEM-EDX 联用仪上进行,加速 电压为 20 kV. 采用 XRD (PANalytical X'Pert) 检测合 金膜的金晶结构,并根据 Vegard 定律^[18]计算 PdAu 合金膜的金属组成. 操作条件为: 电压 40 kV, 电流 40 mA. 扫描速率 5°/min.

2 结果和讨论

2.1 PdAu合金相的形成

图 1 是在 Pd 膜表面进行化学镀 Au 40 min 后的 SEM照片. 由图可见, 膜表面完全被粒径均一(约60 nm)、分布均匀的Au粒子覆盖. 粒径较小的Au颗粒 更易于向Pd晶格中快速扩散.

图 2 是 PdAu 膜层样品在 823 K 下 H₂和 N₂气氛 中热处理后的 XRD 谱. 由图可见, 两个新鲜基准样 品的衍射峰几乎完全重合,说明采用该化学镀技术



图 1 高温处理前 PdAu 膜的 SEM 照片 Fig. 1. SEM image of PdAu alloy membrane before annealing.

制备的 PdAu 膜层金属分布均匀.在H₂和N₂气氛中, Pd和Au的衍射峰分别向低角度和高角度移动,Au 衍射峰的移动速度更快.这是因为Au的Tammann 温度比 Pd低约 250 K^[5],故Au向 Pd晶格中扩散的速 度更快.当合金化时间为6h时,Pd和Au的衍射峰部 分重叠并在50h后基本形成单峰结构,再经过50h 后 PdAu 合金的衍射峰进一步向低角度移动,最后该 PdAu 合金衍射峰在100~200h退火时间内其衍射角 2 θ 仅向低角度移动 0.033°. Au 富集一侧的Au 含量 基本保持不变,说明经过 200h高温退火处理 PdAu 两层金属已达到完全合金化.此时根据金属组成和 d 值之间的经验关系式^[18]及 Bragg 方程可以计算出 合金化后 PdAu 合金膜中的Au含量.在H₂和N₂气氛 中 PdAu 合金的衍射峰角度最终恒定于 39.92°, d = 3.9087 nm, w(Au) = 17.37%.该实验结果说明,H₂和





N₂气氛对双层 PdAu 合金膜的合金化进程无显著影响,两者均需约 200h 退火处理时间.

在 Pd 与 Au 之间的相互扩散中,由于 Au 的 Tammann 温度较低,因而 Pd 向 Au 的扩散成了合金 化进程的控速步骤.在H₂气氛中,Pd及 PdAu 会与 H₂ 形成 HPd 及 HPdAu 相^[5].由于 Au 不能吸附溶解解离 H₂,为促进更多的 H₂在表面吸附解离,H₂ 会诱导 Pd 合金膜发生表面偏析.因为 H₂的存在能促进底层的 Pd 富集层向膜表面的扩散,从而加快合金化反应的 速率^[19].然而,当已达到完全合金化后,Pd 偏析作用 反而不利于 PdAu 膜形成均质合金.XRD 结果对 PdAu 合金膜退火处理时间具有指示作用,200h 为适 宜的合金化时间.H₂诱导下的 Pd 偏析作用需要膜两 侧存在 H₂压差;合金化实验中由于膜两侧不存在 H₂ 压差,故 Pd 偏析作用对合金化速率影响很小,H₂与 N₂之间对合金化速率影响不大.

此外, N₂气氛中 PdAu 的衍射峰在合金进行 50 h 后变得更为狭窄,并且一直延续到 200 h. 这表明 N₂ 气氛中 PdAu 合金粒子晶粒尺寸烧结长大比 H₂气氛 下更为显著. 烧结长大的 PdAu 粒子一方面减小了 PdAu 合金膜用于氢渗透所需的有效面积,另一方面 在退火处理过程中也更易于引起膜表面形貌的大幅 度变化,从而更易导致在膜面形成针孔或缺陷影响 合金膜的 H₂/N₂分离选择性. 另外, Jun 等^[20]指出, H₂ 能促进金属迁移是由于 H₂在 Pd 晶格上的解离吸附 在一定程度上弱化了 Pd-Pd 间的键合,从而有利于 Pd 的扩散. 因此, Pd 合金膜在 H₂气氛中进行合金化 处理更有利.

2.2 PdAu合金膜的性能

在823 K下 H₂气氛中对双层 PdAu 合金膜进行 高温退火处理, PdAu 膜 H₂渗透速率 (J_{H2}) 随退火时 间变化的结果见图 3. Pd 对 H₂具有解离吸附作用, 而 外层 Au 对 H₂没有解离吸附作用^[5]. 因此退火初期的 J_{H2}很小.随着 Au向 Pd 膜层扩散并形成合金, 膜表面 不断富集的 Pd 对 H₂具有吸附解离作用, 从而促进了 J_{H2}的增加.在退火处理约 100 h 后, PdAu 合金膜的 J_{H2}趋于稳定.在退火处理进行 107 h 时, J_{H2} 为 1.03 mol/(m²·s), H₂/N₂分离选择性为 1 036; 再经过约 250 h 退火处理, J_{H2}仍然保持稳定.故可认为此时已达到 完全合金化.在合金化进行过程中, PdAu 合金膜的 N₂渗透速率 (J_{N2}) 随退火时间先增加而后趋于平缓,



图 3 PdAu 合金 H₂/N₂ 渗透速率随合金化时间的变化 Fig. 3. H₂/N₂ fluxes of fresh PdAu alloy membrane at 100 kPa pressure as a function of annealing time at 823 K.

整个退火处理过程中 J_{N2} 由退火处理15h时的0.57×10⁻³ mol/(m²·s) 增加到 396 h时的1.91×10⁻³ mol/(m²·s).

在不同温度下对 PdAu 合金膜进行 H₂渗透性能 评测,并通过不同压力下 J_{N2} 来校正实际透过 PdAu 膜表面的 H₂渗透值^[21]. 图 4 是 Pd 膜和 PdAu 合金膜 (合金化完成后) J_{H2} 的比较. 由图可见,在 623~823 K 范围内 Pd 膜的 J_{H2} 明显低于 PdAu 合金膜,尤其在 623 K 时 Pd 膜和 PdAu 合金膜的 J_{H2} 分别为 0.21 和 0.44 mol/(m²·s), PdAu 合金膜的 J_{H2} 位为 Pd 膜的两倍. Gryaznov等^[8]研究了 773 K 下 Au 含量分别为 5%, 10%, 15% 和 20% 时膜厚度相同的 PdAu 合金膜与纯 Pd 膜 J_{H2} 值之比 (1.8~2.2),但他们并未给出膜厚度和 J_{H2} 的确切数值.本文通过在纯 Pd 膜上再次进行化 学镀 Au 制备 PdAu 合金膜,膜厚度略有增加,但其



图 4 PO 胰和 POAU **二** 並展刊 J_{H2} 值和加度 以天示 **Fig. 4.** H₂ fluxes through Pd membrane and PdAu alloy membrane at 100 kPa pressure as a function of temperature.

J_{H2}值显著提高,且实验结果在文献[8]报道的范围之内.

H₂渗透通量正比于H在合金中的平衡溶解度和 扩散速率^[5].H在PdAu合金中的平衡溶解度随着Au 含量的增加而增大,并在w(Au)=32%时达到最大 值,随后逐渐减小^[22];H在PdAu合金中的扩散速率 随Au含量的增加缓慢减小,在w(Au)=9%时达到最 低值,而后缓慢增加,当w(Au)>17%后快速降低^[22]. 因此,当w(Au)=17.37%时,尽管PdAu膜的厚度比 纯Pd膜略有增加,但整体平衡溶解度和扩散速率的 乘积,即PdAu合金膜的H₂渗透通量比Pd膜的H₂渗 透通量值大,宏观上表现为更高的J_{H2}值.

由图 4 中 J_{H2} 值并根据 Arrhenius 方程,在 423~823 K 内对 J_{H2} 进行线性拟合得到 Pd 膜和 PdAu 合金膜的 E_a 值.通过计算可得 Pd 膜的 E_a = 14.36 kJ/mol (623~823 K); PdAu 合金膜的 E_a = 8.83 kJ/mol (573~823 K), E_a = 15.75 kJ/mol (423~573 K).在 623~823 K 间 PdAu 合金膜比纯 Pd 膜的 E_a 值低.同 时,当温度降到 573 K 时 PdAu 合金膜 E_a 值明显增大. Rodina 等^[11]采用冷轧法制备了 100 µm 的非担载 Pd₇₈Au₂₂ 合金膜,且在 573 K 附近观察到类似的现象. 膜厚度的不同直接影响到 H₂ 传质控速步骤的烟率 越大,同时在温度降低过程中 J_{H2} 值出现拐点的温度 也将更低^[23].



图 5 PdAu 合金膜的截面形貌 Fig. 5. Cross section morphology of PdAu alloy membrane.

本文的实验结果与 Pd 膜、PdCu 膜在低温时出现 *E*a增大的变化情况类似^[23,24],说明 PdAu 膜在高温时以体相扩散为主的 H₂ 传质步骤逐步转变成低温以表面扩散为主的 H₂ 传质步骤.

将完成气体评测后的 PdAu 合金膜进行 SEM/EDX 截面厚度和组成表征, PdAu 合金膜截面 厚度见图 5. 由图可见,该合金膜厚度均一(厚度约为 2 μm). EDX 分析样品截面所选区域的各元素组成 为: O 29.84%, Zr 0.14%, Au 10.77%, Pd 57.25%. PdAu 合金膜截面 EDX 结果与 XRD 计算结果具有非常相 似的 Au 含量 (误差 < 6%),表明该 PdAu 合金膜制备 技术具有高的重复性.

3 结论

在致密 Pd 膜上采用无氰化学镀 Au 技术制备出 高性能双层 PdAu 合金膜,厚度为 2 μm 的 Pd_{82.7}Au_{17.3} 膜在 823 K 下需要 200 h 形成均质合金,同时 H₂较 N₂ 是更为理想的合金化气氛.在 623~823 K 范围内,向 纯 Pd 膜体系中添加 17.37%Au 组分,可显著提高 PdAu 合金膜的 H₂渗透能力并降低其透 H₂活化能; 当温度低于 573 K 时, PdAu 合金膜的 H₂渗透速控步 骤由体相扩散为主的 H₂ 传质步骤过渡到表面扩散 为主的 H₂传质步骤.

参考文献

- Shi L, Goldbach A, Zeng G F, Xu H Y. J Membr Sci, 2010, 348: 160
- 2 Shi L, Goldbach A, Zeng G F, Xu H Y. Catal Today, 2010, doi:10.1016/j.cattod.2010.02.038
- 3 曾高峰, 史蕾, 徐恒泳. 催化学报 (Zeng G F, Shi L, Xu H Y. *Chin J Catal*), 2009, **30**: 1227
- 4 Shu J, Grandjean B P A, Neste A V, Kaliaguine S. Can J Chem Eng, 1991, **69**: 1036

- 5 Paglieri S N, Way J D. Sep Purif Methods, 2002, 31: 1
- 6 Edwards J K, Solsona B, Ntainjua E N, Carley A F, Herzing A A, Kiely C J, Hutchings G J. Science, 2009, 323: 1037
- 7 Ayturk M E, Kazantzis N K, Ma Y H. *Energy Environ Sci*, 2009, **2**: 430
- 8 Gryaznov V. Sep Purif Methods, 2000, 29: 171
- 9 McKinley D L. US 3 350 845. 1967
- 10 Maeland A, Flanagan T B. J Phys Chem, 1965, 69: 3575
- 11 Rodina A A, Gurevich M A, Doronicbeva N I. Russ J Phys Chem, 1971, 45: 621
- Mallory G O, Hajdu J B. Electroless Plating Fundamentals and Applications. New York: Noyes Publications, 1990. 401
- 13 Okazaki J, Tanaka D A P, Tanco M A L, Wakui Y, Ikeda T, Mizukami F, Suzuki T M. *Mater Trans*, 2008, 49: 449
- 14 Gade S K, Payzant E A, Park H J, Thoen P M, Way J D. J Membr Sci, 2009, 340: 227
- 15 Tosti S, Bettinali L, Castelli S, Sarto F, Scaglione S, Violante V. J Membr Sci, 2002, 196: 241
- 16 史蕾, 洪学伦, 侯守福, 徐恒泳. 石油化工 (Shi L, Hong X L, Hou Sh F, Xu H Y. Petrochem Technol), 2007, 36: 692
- 17 Zeng G F, Goldbach A, Xu H Y. J Membr Sci, 2009, 326:681
- 18 Maeland A, Flanagan T B. Can J Phys, 1964, 42: 2364
- 19 Shu J, Bongondo B E W, Grandjean B D A, Adnot A, Kaliaguine S. Surf Sci, 1993, 291: 129
- 20 Jun C S, Lee K H. J Membr Sci, 1999, 157: 107
- 21 Uhlhorn R J R, Keizer K, Burggraaf A J. J Membr Sci, 1989, 46: 225
- 22 Sonwane C G, Wilcox J, Ma Y H. J Chem Phys, 2006, 125: 184714
- 23 Ward T L, Dao T. J Membr Sci, 1999, 153: 211
- 24 Yuan L X, Goldbach A, Xu H Y. J Phys Chem B, 2007, 111: 10952